

自動XYステージ付5°反射/透過測定システムの紹介

日立紫外可視赤外分光光度計 UH4150

5 Degrees Reflectance / Transmittance Measurement System with automatic XY Stage

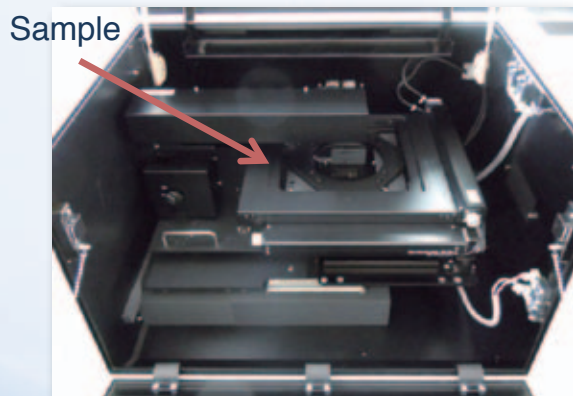
◎ 特 長 ～Feature～

- 自動で入射角5°の相対反射スペクトル及び入射角0°の透過スペクトルの測定が可能
It is possible to measure automatically 5 degree relative reflectance and 0 degree transmittance.
- ガラスフィルタホルダと比較し、試料の設置などに関わる作業時間を1/10に削減
Time for sample setting of automatic XY stage is 1/10th shorter than that of glass filter holder.
- 自動XYステージを用いることで、再現性の良いスペクトルが取得可能
Automatic XY stage offers excellent repeatability of the measurement.



UH4150

◎ 測 定 ～Measurement～



自動XYステージ付5°反射/透過測定システム
5 Degrees Reflectance/Transmittance Measurement System
with automatic XY Stage

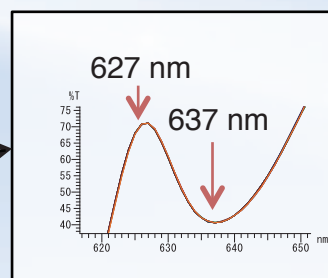
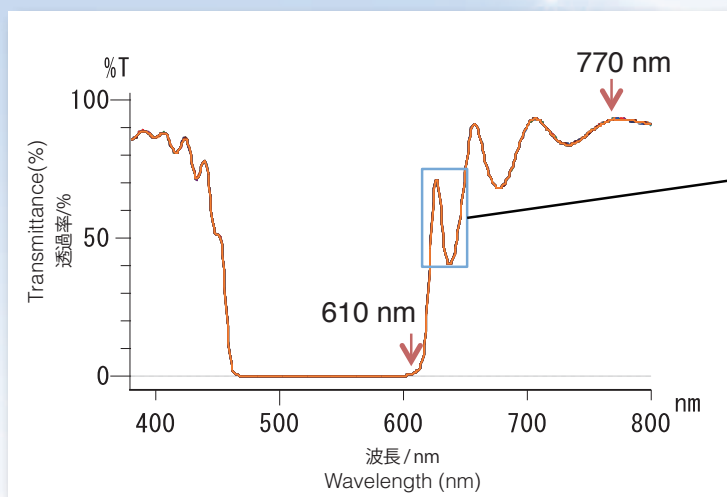
- 自動XYステージシステムを使用することにより、測定が終了するまで時間的な拘束を受けないため、測定に関わる時間が大幅に短縮(1/10)され作業の効率化が期待できます。

After samples are set on the automatic XY stage system, they are automatically measured. High efficiency measurement comes true and measurer can get extra time to do another thing.

<Specification>

Wavelength : 240～2600 nm
Beam size %T : 7.1 mm(W) × 11.5 mm(H)
%R : 8.7 mm(W) × 11.9 mm(H)
Sample holder : Special order
Sample thickness : 0.7～5 mm

- 移動を含めた光学薄膜の25回繰り返し測定 Thin film measurement for 25 times repeatability



自動XYステージの移動を含む測定再現性(25回)
25 times measurement including automatic XY stage moving.

Wavelength (nm)	610	627	637	770
Transmittance (%)	1.33±0.01	55.63±0.28	40.70±0.02	92.97±0.12
RSD (%)	0.57	0.5	0.06	0.12

光学薄膜の25回繰り返し測定結果
Thin film measurement for 25 times repeatability

※ 装置・付属装置の外観等は予告なく変更される場合があります。